

广东省真空学会

粤真发〔2021〕05号

关于发布《真空镀膜设备 电磁兼容 屏蔽与辐射安全技术规范》《高精度磁控溅射镀膜设备通用技术要求》《真空表面处理工艺用离子源》等3项团体标准的公告

各有关单位：

根据《广东省真空学会团体标准管理办法》规定，由中山凯旋真空科技股份有限公司牵头制定的《真空镀膜设备 电磁兼容 屏蔽与辐射安全技术规范》《高精度磁控溅射镀膜设备通用技术要求》等2项团体标准，以及中山市博顿光电科技有限公司牵头制定的《真空表面处理工艺用离子源》团体标准，业已通过专家审定并经公示无异议。经学会批准和编号，现对该3项团体标准予以发布，于2021年6月28日起实施。标准编号和名称如下：

T/GVS 001—2021《真空镀膜设备 电磁兼容 屏蔽与辐射安全技术规范》

T/GVS 002—2021《高精度磁控溅射镀膜设备通用技术要求》

T/GVS 003—2021《真空表面处理工艺用离子源》

在标准使用过程若有疑问，请径向学会联系。

联系人：唐振方 13609644416



广东省真空学会
2021年6月28日